

XSD50-07GRCH-SYS

材料分野の構造解析などで用いられているX線吸収微細構造測定に必要なシリコンドリフト検出器、データ計測ボード、検出器用電源が一つになりました。高い計数率とエネルギー分解能を有したシリコンドリフト検出器を多素子化し高感度化を実現しました。また、トランジスタリセット処理とDSP処理を適切に行うことで高計数測定が可能です。

グラフェン窓付シリコンドリフト検出器

XSD50-07GRCH

●コリメート面積 329mm²
(collimated to 47mm²×7素子)

●有効面積 455mm²
(65mm² × 7素子)



検出器背面

筒長さ：200mm (デフォルト)

*改造は別途費用が発生いたします。

&

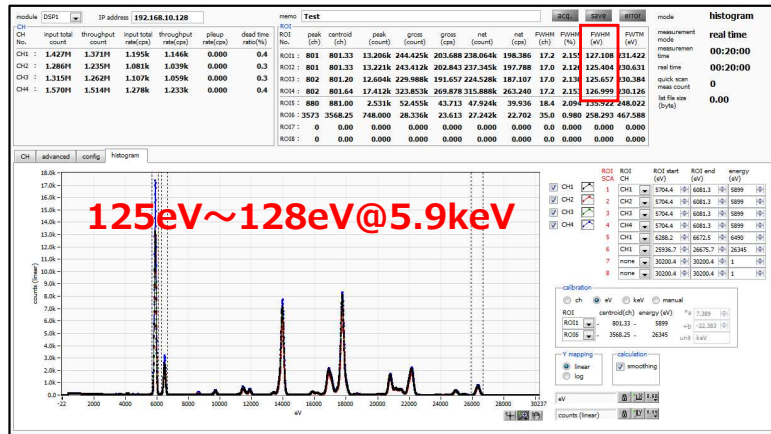
&



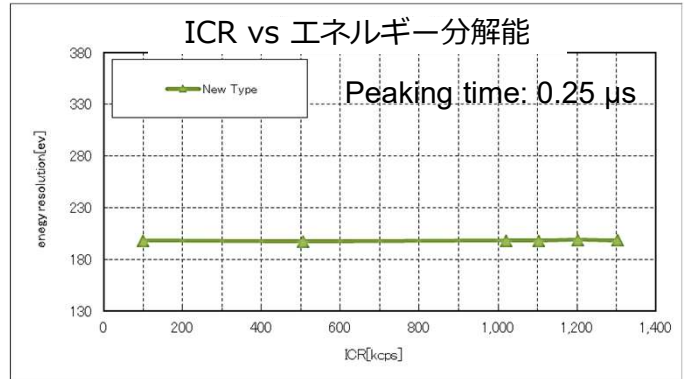
NIM型
検出器用電源
APN3900
1台



NIM型
計測モジュール
APN504X
2台



*NIMピン電源が必要です。



仕様

機能	ヒストグラム、リスト、波形、ROI-SCA
エネルギー分解能	125eV~128eV@5.9 keV MnKa (OCR: 1000 k, Peaking time: 0.25μs)
ADC	100 MHz, 16-bit
SDD用電源	-200V、±5V、+3.3V
通信1/F	ギガビットイーサネット (TCP/IP)
付属	データ収集アプリ、サンプルプログラム 取扱説明書

